技術論文

フロー式溶液導電率法に基づく二酸化硫黄の小型検出器

戸田 敬^{®*}, 井上 博史*, 實 政 勲*

Miniaturized detector of sulfur dioxide based on the flow conductometry of an absorbing solution

Kei Toda*, Hiroshi Inoue* and Isao Sanemasa*

(Received 20 April 1998, Accepted 1 July 1998)

A miniaturized detector based on absorbing conductometry was constructed in order to measure the SO₂ concentration in air. This detector is not only small, but is also capable of continuous measurement of SO₂, unlike the conventional detectors for intermittent SO₂ measurements. Two bilateral pairs of Pt electrodes were fabricated on a glass-epoxy substrate through conventional photolithography and sputtering. On this substrate, a cavity for the flow of an absorbing solution was formed with a Teflon sheet and a gas-permeable membrane. The absorbing solution, H₂SO₄-H₂O₂, was made to flow through this cavity of 2 mm in width and 0.5 mm in thickness by applying pressure to a reservoir of the The sample gas was introduced into the other side of the membrane. Gaseous SO₂ permeated through the membrane and dissolved into the absorbing solution, resulting in an increase in the electrical conductivity of the solution. Any change in the conductivity was monitored using Pt electrodes located both up- and downstream of the absorbing zone, and thus the SO₂ concentrations were determined. The sensitivity and response time largely depended on the flow rate of the absorbing solution. Since the standard flow rate employed was 20 µl min⁻¹, the volume of the waste solution, even over long-time operation, was sufficiently small to be carried. When the absorbing solution was flowed at this rate, from 10 ppb to 1 ppm of SO2 could be measured and the change ratio in the conductivity was 0.971 ppm^{-1} . The response time $(T_{90\%})$ was 82 sec under the same conditions. Other gases interfered slightly; e.g. the sensitivity to CO_2 was about 1/30000 of that of SO₂, so the selectivity of this method was sufficiently good for This study furnished a step for constructing a miniaturized total chemical analysis system (μ TAS) for SO₂ measurements.

Keywords: detector of sulfur dioxide; flow absorbing solution; conductometry.

1 緒 言

石炭を多く使用している途上国や国内の火山地帯など では、今でも安価で保守性の優れた二酸化硫黄測定器を

^{*}Department of Environmental Science, Faculty of Science, Kumamoto University, 2-39-1, Kurokami Kumamoto 860-8555

^{*} 熊本大学理学部環境理学科: 860-8555 熊本県熊本市 黒髪 2-39-1

必要としている。大気中の SO_2 を自動計測するには、溶液導電率法 $^{1/2}$ 7が広く用いられてきた.これは、一定容量の吸収液に試料ガスを通気し、このとき溶け込んだ SO_2 が硫酸になって導電率が上昇することを利用している.しかしこの方法では、大量の吸収液を貯蔵タンクに 定期的に供給する必要がある.又、通常 1 バッチ当た り 1 時間の通気を行ってこの間の平均を測定するため、一時的な濃度の上昇を把握することができない.更に、吸収液や洗浄液の貯蔵タンクも含めると装置が大型になるので、最近では紫外線蛍光法 $^{1/2}$ 3など乾式のものが主流になりつつある.

一方、この原理をイオンクロマトグラフィーやキャピ ラリー電気泳動又はフローインジェクション分析(FIA) に応用して, 大気中に含まれる酸性物質の成分を半連続 的かつ高感度に測定する手法が最近試みられている. こ れらの方法では、ガスの目的成分をいったんデヌーダー もしくは拡散スクラバーと呼ばれるガス吸収部に取り込 んで測定する.ガス吸収部には固体型3)~9)もあるが、湿 式 $^{(0)\sim28)}$ のものは、テフロン $^{20)21)$ やポリプロピレン $^{22)23)}$ な どの多孔性チューブ内に貯えた吸収液を利用したり、ガ ラス内壁をアルカリ性吸収剤でぬらしたもの²⁴⁾,白金ワ イヤーループに微小な吸収液滴を設置したもの²⁵⁾など, 種々のものが報告されている.以上のような、ガス吸収 部と測定操作の組み合わせは、いずれも一工程の分析時 間が数分から十数分と短時間であり、環境のモニタリン グには好都合である.しかし従来のバッチ法と同様,装 置が大がかりであるし、測定シーケンスを組んでいるた めリアルタイムでの測定が困難である.

そこで,連続測定が可能で,簡易な,かつ小型の検出 器の開発を目指して本研究に着手した. 従来のバッチ式 と異なり連続測定を行うためには、ガス透過膜を介して 試料ガスに接するように吸収液を連続的に流す必要があ る. 同じ湿式でも、電気化学的なガスセンサー1)では、 電極表面の劣化や、電解液の蒸発・成分変化による性能 の変化が懸念される.これに対し本法では、新鮮な吸収 液が連続的に供給され、電極での化学反応も原理上は伴 わないので,安定した特性の維持が期待される.しかも, 先のような試み $^{10)18)^{-28)}$ と異なり、一つのモジュールに ガス吸収部と測定電極、流路を一体化すれば、より効率 的な測定が可能になる. 最近では miniaturized total chemical analysis system (μTAS) が注目を集めているが, 生体試料への応用例^{29)~31)}が多く、環境分析に適用した 報告例は少ない. 環境分析においても, 検出器を小型化 することは, 試料の拡散による分析中の希釈を低減した り薬液の消費量を削減するのに好都合である. 今回,

 SO_2 を対象とした μ TAS 構築の第 1 歩として,製作の容易な構造を考案し試作を行った。本研究でのガス吸収部には,従来の多孔性円筒チューブ^(8)~28)に代わり,平面型のガス透過膜を採用した。通常このような平面型デバイスでは,シリコンやガラス基板が用いられているが,組立てが容易でかつ破損しにくいガラスエポキシ製の基板とスペーサーを用いて流路を作製した。平面型のデバイスは,電気化学分析におけるマイクロアレイ電極^{32)~34)}と同様にフォトリソグラフィーを用いての製作が可能である。又,ガス吸収部と導電率測定電極を同一基板上に設ければ,デッドボリュームを極めて小さくできる。このような小型化とフロー式との組み合わせにより,連続測定が可能で,かつ吸収液の使用量が極端に少ない検出器を構築でき,新しい用途への展開も期待される。

2 実 験

2·1 試薬

ガス吸収液には、5.0 μM 硫酸酸性の 6.0×10⁻⁴% 過酸化水素水溶液を用いた.これは、和光純薬製の特級濃硫酸と三徳化学製特級過酸化水素水(30%)を、イオン交換後蒸留した水で希釈して調整した.調整時の導電率は 4.0 μS cm⁻¹であった.

2・2 検出器の製作

今回の実験で作製した検出器を Fig. 1 に示す. プリ ント回路基板用に市販されている板厚 1.6 mm のガラス エポキシ基板 (No. 32, サンハヤト製) を 30 mm×30 mm の大きさに裁断し、この表面に導電率測定用の電極 を作製した. 電極作製には、半導体の製作工程に利用す るフォトリソグラフィーを用いた.まず,基板にフォト レジスト (MP 1400-22, シプレイ・ファー・イース ト・ジャパン製)を 1000 rpm でスピン塗布した.この フォトレジストを80℃で20分乾燥させた後,電極パ ターンのマスクを通して紫外線を露光し、クロロベンゼ ンに 2 分含浸した後、専用現像液で現像した. このレ ジストパターン上からクロム膜、次いで白金膜を高周波 スパッタによりそれぞれ約50,200 nm の厚みで形成し, リムーバー中で不要な金属パターンをレジストごとはく 離した.マスクは、OHP 用シートにレーザープリンタ ーで印刷したパターンを2インチ角のフォトプレート (HRP-SN-2, コニカ製) に焼き直して作製した. 白金電 極を形成した基板は、電極窓すなわち導電率を測定する ために電極が溶液に露出した部分と, 配線取り出し用の パッド部分を残して、フォトレジストでコーティングし

技術論文

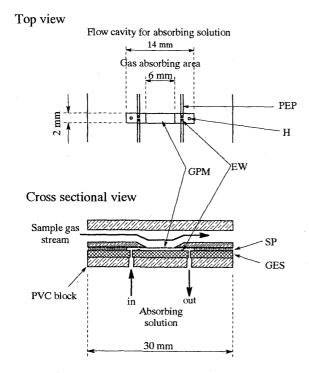


Fig. 1 Structure of the miniaturized SO₂ detector PEP: Pt electrode pattern; H: holes for inlet and outlet of absorbing solution; EW: electrode windows (they are the area where the electrodes are exposed to the solution, and the remnants are covered with the resist film); GPM: gas permeable membrane; SP: PTFE sheet spacer; GES: glassepoxy substrate

た. 続いて、パッドに銀ペーストで直径 0.35 mm のエナメル線を取り付けた後、絶縁を確実にするため電極窓を残して基板すべてに黒の油性ペンキをスプレーした。電極窓の大きさは 0.3 mm×0.3 mm、一対の電極窓の中心間距離は 0.6 mm とした.

このように作製した基板の上に、液の流路に相当する幅2mm、長さ14mmの長方形の穴を開けた厚さ0.5mmのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製シート、及びガス透過膜を重ね、透明塩化ビニル(PVC)で工作したブロックで固定した。ガス透過膜にはPTFE製フロロポアメンブランフィルター(NP-022、フロン製)を用いた。PVC製のブロックにはガスの流路や配管取り出し口も設けた。

2・3 評価システム及び実験操作

ガス透過膜の内側に吸収液,外側に試料ガスを,特に断らない限りそれぞれ $20 \mu l \, min^{-1}$, $100 \, m l \, min^{-1}$ の流量で流し,このときの吸収液の導電率変化を交流でモニ

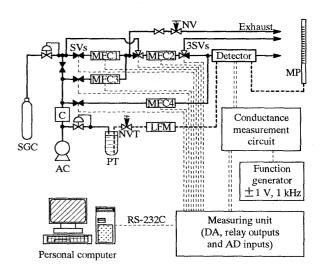


Fig. 2 Experimental system for evaluation of the miniaturized detector

SGC: standard gas cylinder; AC: air compressor; PT: pressure tank of the absorbing solution; SVs: solenoid valves; 3SVs: 3-way solenoid valves; NV: needle valve; NVT: needle valve made of Teflon for flow control of the absorbing solution; MFC: mass flow controller; LFM: liquid flow meter; MP: 1 ml mess pipette for measurement of flow rate of the absorbing solution

タリングした。すなわち、 ± 1 V、1 kHz の正弦波を二対の電極間にそれぞれ印加し、このときの電流を電圧に変換し、増幅して出力を取り出した。試料は、1000 ppm の SO_2 標準ガスボンベ(住友精化製)を大気で希釈して任意濃度の SO_2 を調整した。ガスの濃度調整や出力のモニタリングは Fig. 2 のようにすべて計測ユニット(ゼスト製)を通してコンピュータ上から行った。この計測ユニットの基本仕様は当研究室で設計し、DA出力、リレー出力及び AD入力それぞれ 8 チャンネルずつのポートを装備している。導電率測定用の電極は二対、すなわちガス透過膜の上流側(REF)と下流側(SEN)にあり、REF の導電率に対する SEN の比を最終的な出力信号として扱った。なお、実験はすべて 22 ± 2 の室温で行った。

3 結果と考察

3・1 各種パラメーターの検討

本法の最適条件を決定するために種々の検討を行った. 当初, 吸収液の送液はダブルプランジャーポンプを使用していたが, 溶液の脈動による出力ノイズが大きく, 測定に用いるのは困難であった. しかもこの手のポンプでは微小流量域(数十 μl min⁻¹) での制御が難しい.

そこで、 $0.5 \, \mathrm{kg \ cm^{-2}}$ に調整した圧力タンクに吸収液を入れ、この後段のテフロン製ニードルバルブにて流量調整を行った。測定モジュールからの排出液の正確な流量は、メスピペットとストップウォッチで測定し、評価実験中流量変化のないことを液体微小流量計 LF-410(エステック製)にて監視した。プランジャーポンプと圧送方法でのシグナルの違いを Fig. 3 に示す。縦軸は、信号の変化量 ΔS をベースラインの値 S_0 で割った信号の変化率 $\Delta S/S_0$ をとった。Fig. 3 のように、圧送方式に切り換えることで格段にノイズを低減することができた。又、 SO_2 フリーの大気に切り換えたときのテイリングも

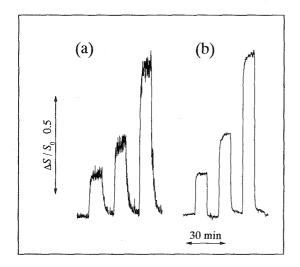


Fig. 3 Effect of pumping methods on the output signals

Response curves (a) and (b) are in case of pumped flow and air-pressurized flow, respectively

In each method, responses to 5, 10 and 20 ppm of SO_2 were recorded. Flow rates of the absorbing solution were 52.1 μ l min⁻¹ (a) and 53.1 μ l min⁻¹ (b)

圧送方式のほうが小さくなっている.これは、機械的なポンプを使用した場合、脈動により吸収液が凹凸のある透過膜の内部に入り込む、あるいは押し込まれるためではないかと考えている.

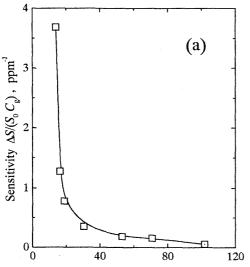
感度を向上させるには捕そく率, すなわちサンプルガ ス中の SO。の吸収液に取り込む割合を上げることが重 要である. そこで、ガス透過膜を変えて実験を行った. 結果を Table 1 に示す. テフロン製メンブランの孔径 を 0.22, 1, 2, 10 μm と変えて実験を行った. 厚みが 同じ100 µm のメンブランでは、孔径が1より2 µm の ほうが感度も良かった.しかし、全体にわたってみると、 孔径の小さいほうが応答も大きい傾向がある. 応答の大 きさは孔径よりむしろメンブランの厚みへの依存が大き いようである。細孔のないメンブランの場合、SO2に対 する応答が見られなかったが、ある程度の細孔があれば 測定に用いることができる. 又, 親水処理を施したポリ エステル製メンブランを使用した場合, 吸収液がメンブ ランの外側に漏れ、使用することができなかった.この ように、ガス透過膜は疎水性である必要があった. 又、 メンブランの材質を変えて捕そく率を調べた報告もある が, 材質による捕そく率の明確な差異は見られていな い²⁸⁾. 以後の実験では、最も感度の大きかった孔径 0.22 μm のテフロンメンブランを用いて実験を行った.

応答の大きさは吸収液流量に大きく依存するので、この点について調べてみた。 SO_2 1 ppm 当たりの $\Delta S/S_0$ の大きさを感度として定義し、0.5~4 ppm の SO_2 を検出器に導入して得られた検量線の傾きからこの値を求めた。又、試料ガス流量は一定(100 ml min^{-1})で実験を行った。結果を Fig. 4(a) に示す。 Fig. 4(b) には吸収時間 T_{abs} と応答時間も合わせて示している。 応答時間は、 SO_2 濃度を 0 から 1 ppm にしたとき、定常状態の

Table 1 Response characteristics of various gas permeable membranes

Material	Pore size/	Thickness/ µm	Type of membrane	Sensitivity* $\Delta S/(S_0 C_g)$, ppm
PTFE	0.22	60	Flonchemical NP-022	0.177
	1.0	100	Flonchemical NP-100	0.133
	2.0	100	Flonchemical NP-200	0.149
	10	125	Millipore LCWP025	0.0998
	No pore	50	Flonchemical NR-532	0.00
Polyethylene (hydrophilic)	0.20	12	Whatman 7061-2502	Leak of absorbing solution

^{*} Sensitivity defined as $\Delta S/(S_0 C_g)$ is the ratio of signal change ΔS to the baseline value S_0 at 1 ppm of SO_2 , and it was obtained from the calibration curve in the range from 0.5 ppm to 4 ppm. This value was measured at 50 μ l min⁻¹ of absorbing solution flow rate



Flow rate of the absorbing solution / µl min⁻¹

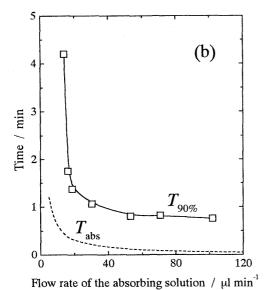


Fig. 4 Effect of flow rate of the absorbing solution (a): sensitivity defined as the ratio of $\Delta S/S_0$ to SO_2 concentration Cg; (b): response time $(T_{90\%})$ obtained when SO_2 concentration was changed from 0 ppm to 1 ppm (\square), and absorbing time T_{abs} calculated (dashed line)

90% の値になるまでの時間($T_{90\%}$)をとった. T_{abs} は、Fig. 1 に示すような寸法のガス吸収部の体積 V_{abs} (6 μ l)を通過するのに必要な時間なので式(1)から算出した.

$$T_{\rm abs} = V_{\rm abs} / Q_{\rm abs} \tag{1}$$

 Q_{abs} は、吸収液流量である、 Q_{abs} を小さくしていくと T_{abs} が長くなるので、感度が増大する、しかし、 Q_{abs} を

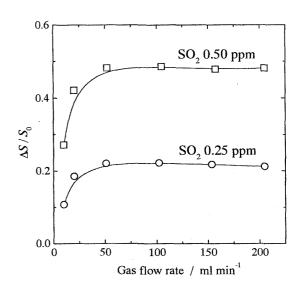


Fig. 5 Effect of flow rate of the sample gas Flow rate of the absorbing solution was 20 μ l min⁻¹

小さくすると感度は T_{abs} に比例する以上に増大している. 導電率の上昇は、 SO_2 の溶解とその酸化の 2 段階により進行するが、酸化剤 H_2O_2 濃度を $6\times 10^{-4}\sim 0.5\%$ の間で変化させても応答の大きさに変化はなかった. 従って 1 段目の溶解平衡が律速になっている可能性がある. 又、流量を小さくすると、感度は良くなるが応答時間が長くなるので、 $20~\mu l \ min^{-1}$ を吸収液の最適流量とした. このときの SO_2 1 ppm 当たりの信号変化率 $\Delta S/S_0$ は 0.971、応答時間 $(T_{90\%})$ は 82 秒であった.

$$CE = C_0 V_{abs}(\Delta S/S_0) / C_g Q_g T_{abs}$$
 (2)

しかし、吸収液の有効体積も非常に小さく、その結果短い吸収時間でも高感度な測定が可能であった.しかも、

ガスに接している吸収液の面積はガス流量に依存しないので,ある程度以上の供給量であれば良いことになる.

3.2 応答特性

 $3\cdot 1$ で決定した最適条件でのチャートを Fig. 6 に示す。この場合,希釈ガスにはボンベエアーを用いた。このように,10 ppb から 1 ppm の間で SO_2 濃度に比例した応答が得られている。このときの捕そく率を計算すると 2.2% となる。又,得られた検量線の相関係数は 0.998 と比較的良好であった。環境基準が 40 ppb(1 日の平均値)や 100 ppb(1 時間の平均値)であること,

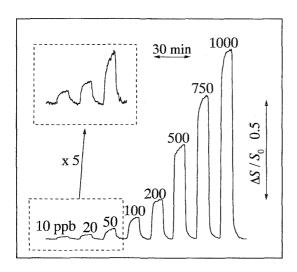


Fig. 6 Response curves obtained in the standard condition of the detector

Flow rates of the absorbing solution and the gas were $20.2 \,\mu l \, min^{-1}$ and $100 \, ml \, min^{-1}$, respectively. Air containing SO_2 and zero gas were put into the detector for $10 \, min$ each. The diluent was supplied from an air cylinder

人が SO_2 雰囲気で作業する場合の許容濃度が 5 ppm であることなどを考慮すると、排ガスや火山ガスを測定するには十分な感度であることが分かる。例えば、火口から西へ 3 km 離れた地点にある阿蘇山草千里では、バックグラウンドとして $10\sim30$ ppb の SO_2 が存在し、火山活動の影響があると 1500 ppb 以上になることが報告されている 35 .

3・3 妨害ガスの影響

妨害が考えられる代表的なガスについてその影響の程 度を調べた、結果を Table 2 に示す、合わせて、それ らのガスのヘンリー定数 KH の比や溶解した化学種の酸 解離定数も掲載した. この条件では, これら妨害ガスの 影響は少なく、特に通常 SO₂の 10000 倍以上存在する CO₂に対する感度は SO₂の約 1/30000 であった. SO₂ に比べ CO2は、ヘンリー定数が小さいばかりでなく、 過酸化水素酸化による溶解平衡のシフトが起こらない し、吸収液の pH では酸解離反応も進まない. 又、NH3 に対しては、濃度によって異なる応答を示した. すなわ ち,2 ppm を超えると SO2 と同じ方向に比較的大きく 応答するが、それ以下では吸収液中の硫酸の中和により 負の応答が見られた. Table 2からも分かるように NH。 は水に溶けやすく、単位濃度当たりの妨害の程度も大き かった. NH₃の妨害が懸念される場合は、シュウ酸カ ラムを試料導入口に設置することでその妨害を取り除け ることが知られている6).

3・4 SO₂による導電率上昇

SO₂による吸収液の導電率上昇は便宜上次のような機構により表すことができる.

ガス透過膜
$$SO_2(gas) \stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow} SO_2(aq.)$$
 (3)

Table 2 Response intensities of interference gases

Gas	Ratio of Henry's law constant ^{a)}	$pK_a^{(b)}$	Experimental sensitivity ratio ^{c)}
SO_2	1.00	1.76 (SO ₂ + H ₂ O)	1.00
		$1.99 \; (HSO_4^-)$	
CO_2	0.0274	$6.35 (CO_2 + H_2O)$	0.0000363
NO_2	0.00807		0.121
NO	0.00155	$3.29 (HNO_2)$	0.0626
H_2S	0.0814	$7.0 (H_2S)$	0.0757
NH_3	50.0	$9.24~(\mathrm{NH_4}^+)$	$0.473 \ (\geq 2 \text{ ppm})$
N_2			0.00

a): Ratio of Henry's law constant to that of SO_2 at 25° C. b): Ka is the dissociation constant of the acidic species dissolved. c): Ratio of sensitivity $\Delta S/(S_0 C_{\pi})$ to that of SO_2

技術論文

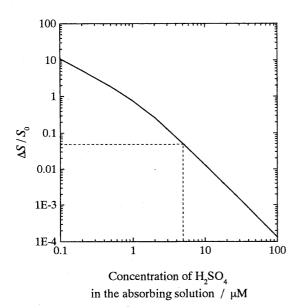


Fig. 7 Simulation of the effect of sulfuric acid concentration contained in the carbonate free absorbing solution on the response to 350 ppm CO₂

$$SO_2(aq.) + H_2O_2 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2^-}$$
 (4)

参考までに、式(1) のヘンリー定数 $K_{\rm H}$ は 1.24 mol I^{-1} atm⁻¹ (25℃) である. SO₂の水への溶解については詳 細な報告もある36. ここで,吸収液のpH はあまり低く ないので, 生成した硫酸のプロトンはほぼ完全に解離す る. 新しく生成したイオンによって導電率が上昇する が、硫酸イオンの当量導電率に比べプロトンの値が大き いので、導電率はほぼプロトンの量に依存する. 25℃ における吸収液 (5.0 μM 硫酸) の導電率は, 4.0 μS cm^{-1} となる. 前節で述べたように、 CO_2 の影響はほと んどなかったが、これは CO2のヘンリー定数が小さい ばかりでなく、わずかながら硫酸酸性となっているため に炭酸の酸解離が進まず、その結果、CO2の溶解を抑 制していることにある. ちなみに吸収液の硫酸濃度と CO₂によるシグナル変化との関係をシミュレーション してみると Fig. 7のようになる. これは、CO2濃度 C_{carb} が 0 から 350 ppm になると、炭酸ガスを含まない 吸収液が溶解平衡に達して導電率がどのように変わるか を, 横軸に吸収液の硫酸濃度をとって描いたものであ る. このシミュレーションは一つの目安であるが、式 (5) により行った.

$$\Delta S/S_0 = \{-2C_0 + (4C_0^2 + 4K_H K_a C_{carb})^{1/2}\}/4C_0 \qquad (5)$$

硫酸濃度 G。が $1 \mu M$ 以上では, $\Delta S/S$ 。はほぼ硫酸濃度の二乗に反比例している.従って,硫酸濃度を上げると CO_2 の影響は大きく減少する.Fig. 7 の破線で示すように,今回の実験で用いた硫酸濃度 $5 \mu M$ では,350 ppmの CO_2 による導電率変化はわずか 5 %程度である.ただ,これ以上硫酸を濃くすると, SO_2 自身に対する導電率の変化率が小さくなってしまうので,この濃度が妥当と考えられる.

3・5 本法の特徴

本法の最も大きな特徴は、SO2濃度を連続的に測定で きる点である.これは、吸収液を試料ガスと接しながら 連続的に流すことで可能になった. 吸収液の流量は20 ul min⁻¹であり、1か月間休みなく使用しても吸収液の 消費量は約860 ml である. バッチ法¹⁾²⁾で1月当たり20 1もの吸収液を使用していたのに比べれば画期的であ る. 又, ガス吸収部を利用した分析システムのこれまで の報告では, ガス吸収部から検出器までの距離が数十 cm あり²³⁾²⁴⁾,内径が細いとはいえ分離に伴う試料帯域 の拡散や時間的ロスが生じがちである. チューブの接続 部や検出器の構造によってはデッドボリュームも大きく なってしまう. 本法では、メンブランの最下流から電極 の中心部までわずか 1.5 mm である. わずかな吸収液の 消費量でもタイムラグの少ない測定が可能である. 又, 従来から平面型検出器に用いられているシリコン基板な どは機械的にもろく, 最終的な組み立てや操作中のハン ドリングが困難であった. 今回のガラスエポキシ基板 は、他の樹脂製ブロックやガス透過膜とともにスタック 状に組み上げて、ボルトなどで機械的に締め付けてシー ルすることが可能である. その結果, 取り扱いが極めて 容易となった.

文 献

- 1) JIS B 7981, 排ガス中の二酸化硫黄自動計測器 (1984).
- 2) JIS K 0103, 排ガス中の硫黄酸化物分析方法 (1988).
- 3) B. R. Fish, J. L. Durham: Environ. Lett., 2, 13 (1971).
- 4) J. L. Durham, W. E. Wilson, E. B. Bailey: *Atmos. Environ.*, **12**, 883 (1978).
- 5) J. Slania, M. P. Keuken, C. A. M. Schoonebeek: *Anal. Chem.*, **59**, 2764 (1987).
- 6) M. Brauer, P. Koutrakis, J. M. Wolfson, J. D. Spengler: Atmos. Environ., 23, 1981 (1989).
- 7) M. Brauer, P. Koutrakis, J. D. Spengler: *Environ. Sci. Technol.*, **23**, 1408 (1989).
- 8) C. L. Benner, D. J. Eatough, N. L. Eatough, P.

- Bhardwaja: Atmos. Environ., 25A, 1537 (1991).
- R. L. Benner, J. Wu, D. K. Nicks: J. Geophys. Res., 102, 16287 (1997).
- 10) P. K. Dasgupta, S. Dong, H. Hwang, H. Yang, Z. Genfa: *Atmos. Environ.*, **22**, 949 (1988).
- 11) N. L. Eatough, S. McGregor, E. A. Lewis, D. J. Eatough, A. A. Huang, E. C. Ellis: *Atmos. Environ.*, **22**, 1601 (1988).
- 12) M. P. Keuken, C. A. M. Schoonebeek, A. Wensveen-Louter, J. Slanina: *Atmos. Environ.*, **22**, 2541 (1988).
- 13) P. K. Dasgputa, P. F. Lindgren: *Environ. Sci. Technol.*, **23**, 898 (1989).
- 14) G. L. Kok, A. J. Schanot, P. F. Lindgren, P. K. Dasgupta, D. A. Hegg, P. V. Hobbs, J. F. Boatman: *Atmos. Environ.*, **24A**, 1903 (1990).
- 15) D. Y. H. Pui, C. W. Lewis, C. Tsai, B. Y. H. Liu: *Environ. Sci. Technol.*, **24**, 307 (1990).
- 16) V. Sotiropoulou, G. P. Vassilev, N. A. Katsanos, H. Metaxa, F. Roubani-Kalantzopoulou: *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, **91**, 485 (1995).
- 17) P. K. Dasgupta, L. Ni, S. K. Poruthoor, D. C. Hindes: *Anal. Chem.*, **69**, 5018 (1997).
- 18) H. R. Beard: Anal. Chem., 44, 1104 (1972).
- 19) J. S. Symanski, S. Bruckenstein: Anal. Chem., 58, 1771 (1986).
- 20) P. K. Dasgupta, W. L. McDowell, J-S. Rhee: *Analyst* [London], 111, 87 (1986).
- 21) Y. Suzuki: Anal. Chim. Acta, 353, 227 (1997).
- L. Bao, P. K. Dasgupta: Anal. Chem., 64, 991 (1992).

- S. Liu, P. K. Dasgupta: Anal. Chim. Acta, 308, 281 (1995).
- 24) P. K. Simon, P. K. Dasgupta: Anal. Chem., 65, 1134 (1993).
- 25) P. K. Dasgupta, S. Kar: Anal. Chem., 67, 3853 (1995).
- P. K. Simon, P. K. Dasgupta, Z. Vecera: Anal. Chem., 63, 1237 (1991).
- I. Gács, R. Ferraroli: Anal. Chim. Acta, 269, 177 (1992).
- 28) W. Frenzel: Anal. Chim. Acta, 291, 305 (1994).
- 29) E. Dempsey, D. Diamond, M. R. Smyth, G. Urban, G. Jobst, I. Moser, E. M. J. Verpoorte, A. Manz, H. M. Widmer, K. Rabenstein, R. Freaney: *Anal. Chim. Acta*, 346, 341 (1997).
- 30) E. Dempsey, D. Diamond, M. R. Smyth, M. A. Malone, K. Rabenstein, A. McShane, M. McKenna, T. V. Keaveny, R. Freaney: *Analyst* [London], **122**, 185 (1997).
- 31) P. S. Hodder, G. Blankenstein, J. Ruzicka: *Analyst* [London], **122**, 883 (1997).
- 32) A. Aoki, T. Matsue, I. Uchida: *Anal. Chem.*, **62**, 2206 (1990).
- 33) O. Niwa, M. Morita: Anal. Chem., 68, 355 (1996).
- 34) M. Chao, H. Huang: Anal. Chem., 69, 463 (1997).
- 35) 直江寬明, 池辺伸一郎, 木下紀正, 金柿主稅, 今村和樹: 日本気象学会秋期大会講演予稿, D155 (1994).
- 36) W. Gerrard: "Solubility of Gases and Liquids", p. 103 (1976), (Plenum Press, New York).

要 旨

溶液導電率法に基づく小型な SO_2 検出器の構築を図った。本法は従来のバッチ法とは異なり,連続測定が可能である。又,同じ基板の上に流路と導電率測定電極があり,デッドボリュームを極めて小さくしている。ガラスエポキシ基板にフォトリソグラフィーとスパッタリングにより導電率測定用の白金電極を形成した。この上にテフロンシートやガス透過膜を組み合わせて,溶液の流路やガス吸収部を形成した。幅 $2 \, \mathrm{mm}$,厚み $0.5 \, \mathrm{mm}$ の流路に硫酸 - 過酸化水素水溶液を圧送で流し,ガス透過膜で隔てた反対側に試料大気を流す。 SO_2 はガス透過膜を通って吸収液に溶け込み吸収液の導電率が上昇する。ガス吸収部の上流及び下流側に設けられた白金電極により,導電率の変化を測定して, SO_2 濃度を計測する。感度や応答時間は,吸収液流量に大きく依存するが,今回の系での標準的な流量はわずか $20 \, \mathrm{\mu l} \, \mathrm{min}^{-1}$ であり,長期の測定でも携帯が可能な消費量である。上記の流量のとき, $10 \, \mathrm{ppb} \sim 1 \, \mathrm{ppm}$ の $SO_2 \, \mathrm{m}$ 定可能であり, $1 \, \mathrm{ppm} \, \mathrm{mas} \, \mathrm{mas}$